多面光変換型光ユニタリ変換器における作製誤差耐性

Robustness of Optical Unitary Converter based on Multi-Plane Light Conversion

⁰田之村 亮汰,唐 睿,種村 拓夫,中野 義昭(東大院・エ)

°Ryota Tanomura, Rui Tang, Takuo Tanemura, Yoshiaki Nakano (The Univ. of Tokyo)

E-mail: ryota_tanomura@hotaka.t.u-tokyo.ac.jp

1. 背景

光 ユ ニ タ リ 変 換 器 (OUC: Optical unitary converter)は多数の直交した入力光信号を任意の異 なる直交基底へと変換する素子である. OUC をコ ンパクトな光集積回路上に実現することで,光通 信,量子演算,光深層学習などの広範な分野への 応用が期待できる.集積 OUC は主にマッハツェン ダー干渉計(MZI: Mach-Zhender interferometer)を

「Clements 方式」[1]等に従って多段にした構成で 数多く実証されている[2].しかし,OUCの性能は 個々の MZI の性能に依存するため、実用的な回路 規模を実現するには、高い作製精度が必要となる. 冗長な MZI を挿入することで作製誤差耐性の向上 が可能だが、消費電力、回路面積、複雑さの観点 から好ましくない[3].

本研究では、多面光変換(MPLC: multi-plane light conversion)に基づいた集積 OUC が、従来型の OUC に対し、優れた作製誤差耐性と特有のスケーラビ リティを有することを示す. MPLC 型では全モー ド間の結合が繰り返し行われるため、個々の作製 精度要求を緩和できるためと考えられる.

2. 原理

図 1(a)に Clements 型 N×N 集積 OUC の構成図 を示す[1]. MZI を多段にすることで構成され,一 つの MZI には 2×2 方向性結合器(DC: directional coupler)と位相シフタの組が2つ含まれる.全ての 位相シフタを[1]に従って設定することで任意の 変換を実現できる. N(N-1)/2 個の MZI に加えて 入力ポート用位相シフタが N 個あるので,合計 N² 個の位相シフタを有する.

図 1 (b)に MPLC 型 N×N 集積 OUC の構成図を 示す[4]. 多ポート DC と位相シフタアレイを多段 にすることで構成される. Clements 型と同じく N² 個の位相シフタを有し, 空間型 MPLC 素子[4]と同 じく位相シフト量を適切に決定することで任意の 変換を実現できる.

3. 計算手法と結果

2 種の構成法に対し,数値計算により作製誤差 耐性を比較した.厚み220nm,幅(W)460 nmのSi 細線導波路を想定した.DCのギャップ(G)を250 nm としたものを設計中心とし,作製誤差として, WとGをそれぞれ±100 nmの範囲で変化させた. 2×2 DCのカプラ長は50:50の分岐比となる20 µm とし,N×N DCのカプラ長はN×10 µm とした.



図 2 ポート数 N=4, 8, 16 の OUC において作製誤差があると きの平均 MSE: (上段) Clements 型, (下段)MPLC 型.

各 DC の伝達行列は固有モード伝搬法により計算 し,損失のない理想的な位相シフタを 8-bit DAC に よって駆動する場合を考えた.2種の OUC につい て 20 通りの所望行列を実現する場合を考え,所望 行列との平均二乗誤差(MSE: mean square error)の 平均を評価指標とした.なお,MPLC型の位相シ フタ値の決定には焼きなまし法を使用した.

図2に2種のOUCについて,計算結果を示す. Clements型OUCにおいては,MSEの小さい領域 は限られたW,Gの範囲内のみであり,ポート数増 大に対しこの領域が狭くなるため,大規模化が難 しいことが示唆される.一方MPLC型OUCでは, MSEがW,Gにほぼ依存せず,ポート数の増大に 対してもこの依存性が変化しない.このMPLC型 における優れた作製誤差耐性とスケーラビリティ は,NポートDCにおいて全モード間で結合が生 じる結果,冗長性が付加されるためと考えられる. 以上より,MPLC型OUCは,特有の作製誤差耐性 とスケーラビリティにより,大規模OUCとその応 用に活用されることが期待される.

謝辞 本研究は、文部科学省科学研究費補助金(26000010) の助成を受けて実施された。

参考文献

[1]W.R. Clements, et al., *Optica*, **3**(12), 1460 (2016).[2] N.C.Harris, et al., *Optica*, **5**(12), 1623 (2018).[3] D.A.B. Miller, *Optica*, **2**(8), 747 (2015).[4] R. Tanomura, et al., *Journal of Lightw Tech*, **38**(1), 60 (2020).[5] J. F. Morizur, et al., *J. Opt. Soc. Am. A*, **27**(11), 2524 (2010).